基于多孔硅分布 Bragg 反射镜的有机微腔的 光学性质*

吕 明 徐少辉 张松涛 何 钧 熊祖洪 邓振波 丁训民

(复旦大学应用表面物理国家重点实验室,上海 200433)

(2000年5月13日收到)

报道了采用多孔硅多层膜作为 Bragg 反射镜的有机半导体光学微腔. 被测样品的光致发光谱半高宽可由无微 腔下的 83 nm 窄化为有微腔时的 4 nm 非共振模得到有效的抑制. 同时共振峰强度的增强和峰位随出射角增大的 " 蓝移 "等微腔效应也被观测到.

关键词:微腔,多孔硅,有机半导体 PACC:7865J,4270J

1 引 言

自从 1987 年 Tang 报道有实用前景的 8-羟基 喹啉铝(Alq)有机电致发光器件(organic lighting emission devices /OLEDs)¹¹以来,有机半导体就因其 高效、全色以及器件的面发射等发光特征成为光电 子器件和平面显示领域中最有前景的材料之一.但 是有机材料本身发光光谱的半高宽(FWHM)往往 宽达 80 nm 甚至上百纳米,这对制造基于三原色的 平面彩色显示器和用于光纤通信的发光二极管非常 不利.而线度在光波长量级的光学微腔能够通过调 制腔内光学模密度分布改变腔内激活物质的自发辐 射特性^[23].利用这一性质,在微腔结构中实现了有 机半导体的窄峰发光⁴⁻¹⁵].

与此同时,在制备多孔硅(porous silicon,PS) 时,人们注意到,多孔硅腐蚀主要发生在孔的根部, 对已形成的多孔硅层没有影响;多孔硅的折射率, 仅决定于多孔度;对确定的硅片和腐蚀液配比,多孔 硅层的多孔度仅决定于腐蚀电流密度.因此,在制备 多孔硅层过程中,不断改变腐蚀电流密度和相应的 腐蚀时间即能得到不同折射率和厚度的多孔硅多层 膜.在此基础上,利用各种腐蚀手段实现了多孔硅光 学多层膜和全多孔硅微腔¹⁶⁻¹⁹.

硅在微电子领域的地位不可替代,但作为一种

间接能隙半导体,在光电子领域却曾长期无所作为. 为此,人们作出了各种尝试,来实现硅基光电子集成.相比较于电致发光效率较低的多孔硅,将高效率 的有机半导体发光材料与发展成熟的硅基工艺相结 合,很有可能是一种工艺简单、成本低廉的实现硅基 光电子集成的更有效的途径.

本文报道制造工艺与传统半导体技术相兼容的 采用多孔硅多层膜作为 Bragg 反射镜,采用有机电 致发光器件中最为常用的 Alq 和掺杂有激光染料 DCM 的 Alq 作为有源层材料的有机半导体微腔,并 研究了其在光激励下的光学性质.

2 实 验

2.1 样品的制备

如图 1 所示 样品为典型的三明治结构.银膜和 10 周期的 λ/4 堆积(quarter wavelength stacks, QWS)高/低折射率多孔硅多层膜充当微腔的两个 反射镜.有源层为小分子有机荧光材料.考虑到银层 对激励光有很强的衰减作用,为了研究微腔结构对 发光谱峰形及其位移的影响,我们分别采用了"高反 射率的厚银镜+Alq有源层 (样品 1)和"低反射率 的薄银镜 + 高荧光效率的掺有质量百分比约为 0.23% DCM 染料分子的 8-羟基喹啉铝有源层 (样

^{*}国家自然科学基金(批准号 169976010)和上海市科委重点科技项目(批准号 199JC14007)资助的课题。



图 1 微腔样品的结构 (a)样品 1,(b)样品 2

品 2)两种组合.

多孔硅 Bragg 反射镜采用阳极电化学脉冲腐蚀 的方法制得.腐蚀所用基片为单面抛光的(100)晶向 p型单晶硅片,电阻率为 0.008—0.02 Ω·cm,经严 格清洗后,在非抛光面蒸铝,并在氮气环境下 450℃ 退火 30 min,形成良好的欧姆接触.用比例为 1:1:2 的氢氟酸(48%)、无水乙醇和去离子水的混合溶液 作电解液,由计算机控制的脉冲电化学腐蚀系统周 期性交替改变腐蚀电流密度,沿纵深方向形成高、低 折射率交替变化的多孔硅 Bragg 反射镜.实验测得 两种反射镜的反射谱如图 2 所示.



图 2 多孔硅 Bragg 反射镜的反射谱

经严格清洗,反射镜被送入超高真空腔体中,在 优于 5×10⁻⁵ Pa 的本底真空下,采用热蒸发的方法 分别淀积有机膜和银膜.淀积过程中蒸发速率和淀 积厚度使用石英晶体振荡器监测,由计算机严格控 制.相应参数如表 1 所示.由传输矩阵理论^[20]计算 得到"Alq/银膜/空气"体系的反射率见图 3.计算中 所用银的折射率 *n* 和消光系数 *k* 由椭偏仪测得 ,纯 Alq 和掺杂 Alq 的折射率在所计算波长范围取 1.72^[21].

表1 样品制备的相关参数

材料		蒸发速率 /(nm/min)	厚度 / _{nm}
Alq	样品1	14	316
	样品 2	34	220
DCM	样品 2	0.078	220
Ag	样品1	2.5	60
	样品 2	2.3	29



图 3 理论计算得到的银膜反射谱

2.2 测量

我们测量了样品的光致发光(PL)谱,并得到了 不同出射角度下的PL谱.所有光谱测量都在一套 ARC SpectraPro-275 光栅光谱仪上进行.激发光为 He-Cd 连续激光器的 441.6 nm 谱线,功率约为 40 mW.光的激励和搜集都在样品的Ag镜侧进行. 不同的出射角是这样得到的:在小角度(小于15°) 采用环形光阑采样,经透镜系统聚焦,进入单色仪; 在大角度时通过旋转样品架使样品平面法线与光路 夹角等于所要求的出射角.

3 结果与讨论

3.1 谱峰的窄化

图 4 是样品 1 的 PL 谱. 可以看出,在预期的 500 nm 附近(495 nm),微腔样品的光谱出现明显的 窄峰(共振峰). 与单纯 Alq 薄膜样品相比,样品 1 PL 谱的半高宽(FWHM)由 83 nm 减小为 4 nm. 共 振峰的存在说明微腔结构起到了很好的限模作用. 必须说明的是,由于银膜的存在,微腔样品和薄膜样 品的 PL 谱强度不具有可比性.



图 4 样品 1 与普通 Alq 薄膜样品 PL 谱的比较 (虚线为多孔硅反射镜的 PL 谱)

图 5 是样品 2 的 PL 谱.为了检验微腔的限模 效应,通过改变腔长将其共振峰位置选为离腔内有 机材料 PL 谱峰位较远的 665 nm.比较样品 2 下镜 面为硅和多孔硅 Bragg 反射镜两部分的 PL 谱(谱 线 *a* 和谱线 *b*),可见由于硅的反射效果远不如多孔 硅反射镜,以前者为下镜面的腔的反馈作用不明显.



图 5 样品 2 的 PL 谱 曲线 *a* 为 Si/Alq DCM/Ag 结构 ;曲线 *b* 为 PS 反射镜/Alq DCM/Ag 结构 (虚线为多孔硅反射镜的 PL 谱)

在谱线 *a* 中 Alq DCM 体系的体发光模未得到有效 抑制,仍然很强,只在 650 nm 位置有一个强度与体 发光峰相近的共振峰.反观谱线 *b*,在多孔硅反射镜 的强反馈下,体发光模得到有效的抑制,在 665 nm 位置出现明显窄化(FWHM = 10 nm)的共振峰,其 强度也增加了一倍以上.相比样品1的共振峰,其 2 的半宽较大.这是因为样品2的银反射镜厚度小 于样品1 相应的在共振峰位置反射率要小得多.这 与 F-P 谐振腔理论的预言是一致的^[22].

为了评估多孔硅反射镜自身发光对微腔样品 PL 谱的影响,我们预先测量了两块多孔硅反射镜的 PL 谱.测量结果如图 4 和图 5 中虚线所示.可见多 孔硅反射镜本身的发光强度是很弱的.加上多孔硅 并不处于微腔中共振模的波峰/波谷位置,不存在微 腔增强效应.可以认为,多孔硅发光对样品 PL 谱的 贡献可以忽略.

3.2 光谱的角度依赖关系

我们测量了样品 2 微腔部分不同出射角度下的 PL 谱. 共振峰位置与出射角度的依赖关系如图 6 所 示. 随出射角增大,共振峰发生蓝移. 这在许多文献 中都有报道^[11,12,14].



图 6 样品 2 共振峰位置与出射角度的依赖关系 (实线为实验结果,虚线为理论结果)

得

微腔的光学长度 L 为^[14]

 $L = \frac{\lambda}{2} \left| \frac{n_{\rm eff}}{\Delta n} \right| + \left| \frac{\Phi_{\rm Ag}}{4\pi} \lambda \right| + n_{\rm org} d\cos\theta_{\rm org} , (1)$

式中 λ 为真空波长 , $n_{\rm eff}$ 为多孔硅多层膜的有效折 射率 Δn 为多孔硅交替层两种折射率的差值 , $n_{\rm org}$ 为有机材料的折射率 ,d 为腔长 , $\theta_{\rm org}$ 为有机薄膜内 光与界面法线的夹角 , $\Phi_{\rm Ag}$ 为光在有机/银的界面的 相移^[23].式中的第一项被称为光进入多孔硅反射镜 的透入深度.第二项被称为光进入银层的有效深度 , 经计算 ,在可见光范围不大于 5 nm ,可以忽略.

由微腔的谐振条件

$$in\theta = n_{\rm org} \sin \theta_{\rm org} , \qquad (3)$$

式中 θ 为出射角 将(1)(3)式代入(2)式有

$$\lambda \propto \sqrt{n_{
m org}^2 - \sin^2 \theta} \left| \left(\left. m - \left| \frac{n_{
m eff}}{\Delta n} \right| \right. \right) \right|$$
 (4)

若认为 $n_{
m eff}/\Delta n$ 为不随波长和角度改变 ,则可

$$\lambda(\theta) = \lambda(0)\sqrt{1 - (\sin\theta/n_{\rm org})^2}.$$
 (5)

从图 6 可以看出理论与实验结果符合得很好.

4 结 论

采用电化学脉冲腐蚀方法制备了 10 周期高/低

折射率多孔硅交替层的 Bragg 反射镜,并以此为衬底制作了多孔硅反射镜/有机半导体发光材料/银镜 结构的光学微腔.该有机微腔结构能将 PL 谱半高 宽由 83 nm 窄化到 4 nm,并有效地抑制非共振模. 改变光谱的搜集角度,观测到共振峰位的蓝移,与理 论值符合得很好.在腔中加入电致发光所需的电极 层和空穴传输层后,有望实现光学性质类似的硅基 微腔有机电致发光器件.

感谢复旦大学物理系半导体研究室赵海斌、邓世虎为本 工作提供计算所需的银的折射率和消光系数.

- [1] C. W. Tang ,S. A. Van Slyke , Appl. Phys. Lett. ,51(1987), 913.
- [2] H. Yokoyama , Science , 256(1992), 66.
- [3] G. Bjork ,S. Machida ,Y. Yamamoto *et al.*, *Phys. Rev.*, A44 (1991) 669.
- [4] T. Nakayama, Y. Itoh, A. Kakuta, Appl. Phys. Lett., 63 (1993) 594.
- [5] N. Takada, T. Tsutsui, S. Saito, Appl. Phys. Lett. 63 (1993), 2032.
- [6] A. Dodabalapur, L. J. Roghberg, T. M. Miller *et al.*, *Appl. Phys. Lett.* 64(1994) 2486.
- [7] N. Takada, T. Tsutsui, S. Saito, Appl. Phys. Lett. 65(1994), 1868.
- [8] A. Dodabalapur, L. J. Roghberg, T. M. Miller *et al.*, Appl. Phys. Lett. **65**(1994), 2308.
- [9] T.A. Fisher ,D. G. Lidzey ,M. S. Weaver et al. , Appl. Phys. Lett. 67 (1995),1355.

- [10] U. Lemmer ,D. Vacar ,D. Moses et al. ,Appl. Phys. Lett. 68 (1996) 3007.
- [11] Z.G. Liu C. J. Tang, W. M. Zhao et al., Acta Optica Sinica, 18(1998), 793(in Chinese] 刘祖刚、唐春玖、赵伟明等,光学 学报,18(1998), 793].
- [12] B. Masenelli ,A. Gagnarire ,L. Berthelot *et al*. J. Appl. Phys. , 85(1999) 3032.
- [13] S. Tokito, T. Tsutsui, Y. Taga, J. Appl. Phys., 86(1999), 2407.
- [14] A. Dodabalapur, L. J. Roghberg, R. H. Jordan *et al.*, J. Appl. Phys. **80** (1996) 6954.
- [15] A. Arena , S. Patane , G. Saitta et al. , Appl. Phys. Lett. ,72 (1998) 2571.
- [16] M. G. Berger , C. Dieker , M. Thonissen *et al.*, J. Phys. , D27 (1994),1333.
- [17] M. G. Berger ,M. Thonissen ,R. Arens-Fischer *et al.*, *Thin Sol-id Films* 255 (1995) ,313.
- [18] L. Pavesi, C. Mazzoleni, A. Tredicucci et al., Appl. Phys. Lett. 67 (1995), 3280.
- [19] C. Mazzoleni ,L. Pavesi ,Appl. Phys. Lett. 67 (1995) 2983.
- [20] Y.C. Lin ,W. Q. Lu, Principle of Optical Thin Films (National Defense Industry Press, Beijing, 1990), p. 32—49(in Chinese) [林永昌,卢维强,光学薄膜原理(国防工业出版社,北京, 1990), p. 32—49].
- [21] P. E. Burrows, V. Khalfin, G. Gu et al., Appl. Phys. Lett. 73 (1998) A35.
- [22] C. C. Davis "Lasers and Electro-Optics Fundamentals and Engineering (Cambridge University Press Cambridge 1995), p. 79.
- [23] Y.C. Lin, W. Q. Lu, Principle of Optical Thin Films (National Defense Industry Press, Beijing, 1990), p. 63 in Chinese J 林永昌, 卢维强,光学薄膜原理(国防工业出版社,北京, 1990), p. 63].

OPTICAL PROPERTIES OF ORGANIC MICROCAVITY BASED ON POROUS SILICON BRAGG REFLECTOR*

LU MING XU SHAO-HUI ZHANG SONG-TAO HE JUN XIONG ZU-HONG DENG ZHEN-BO DING XUN-MIN (Surface Physics Laboratory (National Key Laboratory), Fudan University, Shanghai 200433, China) (Received 13 May 2000)

Abstract

The construction of an organic microcavity with an organic light-emitting thin film sandwiched between a porous silicon Bragg reflector and a silver film is demonstrated. The peak widths of the PL spectra are greatly reduced from 83 nm to 4 nm as compared with those measured from non-cavity structures. The off-resonant optical modes are highly depressed. As is always observed from an optical microcavity ,the peak intensity is enhanced ,and the peak position shows a blue shift with increasing exit angles.

Keywords : microcavity , porous silicon , organic semiconductor PACC : 7865J , 4270J

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 69976010).